

Lasertec News 23

株 主 通 信 第 5 8 期 (2019年7月1日～2020年6月30日)

成長を遂げ新たなステージへ

Lasertec

証券コード6920



2020年6月期(当期)も売上、利益、受注、受注残、すべての面で過去最高となり、4期連続で記録を更新できました。今後も高度化するお客さまのニーズに真摯にお応えし、成長機会を捉えるように尽力してまいります。

代表取締役社長

岡林 理

Q1

これまで数年間にわたって順調に事業が成長し、当期も過去最高の業績を更新しましたが、その要因は何でしょうか。

A1

半導体製造プロセスの最先端分野におけるイノベーションが普及期に入り、その事業機会を捉えることで大きく成長することができました。

当期よりEUV(極端紫外線)リソグラフィが最先端の半導体製造ラインで本格的に使われるようになり、大手ファウンドリが生産能力を拡大するための設備投資を加速したことが追い風となりました。当社は以前より、お客さまからご要望をいただいてEUVに対応した検査装置を積極的に開発しておりましたので、それらの製品が

時宜を得て売上および受注の拡大に貢献した形です。加えて、EUVリソグラフィにおいては従来のリソグラフィ工程と比べてマスク検査の頻度が増えていることもあり、「マスク欠陥検査装置MATRICS X8ULTRA」の受注および売上を大きく伸ばすことができました。

このような環境から、当期の業績は売上高425億72百万円（前連結会計年度比48.0%増）、営業利益150億

62百万円（同89.7%増）、経常利益151億15百万円（同92.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益108億23百万円（同82.4%増）となりました。受注面では、前述の「MATRICS X8ULTRA」に加え、「アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTIS A150」の受注が寄与し、受注高801億75百万円（同80.4%増）、期末受注残高931億63百万円（同67.7%増）を達成しました。

Q2 当期は新中期経営計画フェーズⅢの2年目でしたが、その進捗状況はいかがでしたか。





A2 フェーズⅢの目標としていた「新規事業を大きく売上に結びつける」で順調に成果を上げることができました。

特にEUVマスク検査の分野での成功が大幅な躍進につながりました。前期に引き続き、「MATRICS X8ULTRA」の販売が好調です。1台で既存のフォトマスクとEUVマスクの両方を検査できる機能が、お客様のニーズに

マッチして大変ご好評をいただきました。

また2019年9月には、新製品の「アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTIS A150」を発表しました。これまではEUV光を用いたマスク検査装置が実用

連結業績ハイライト

売上高	受注高	営業利益	当期純利益*
42,572百万円	80,175百万円	15,062百万円	10,823百万円
前連結会計年度比	前連結会計年度比	前連結会計年度比	前連結会計年度比
48.0% 	80.4% 	89.7% 	82.4% 

* 親会社株主に帰属する当期純利益

化されておらず、半導体製造の歩留り向上のために業界全体の課題とされていたのですが、当社が製品化に成功したことで業界発展に大きく貢献でき、大変うれしく思っております。お客さまからの引き合いも強く、当期

から受注にも貢献し始めました。今後は同装置の性能向上とともに、製品供給を滞りなく行えるよう供給体制の強化に努めてまいります。

Q3 コロナ禍による業績への影響はあったのでしょうか。

A3 ヒトやモノの移動規制によって業務効率の低下などはありませんでしたが、主要顧客の投資動向には目に見える変化はありませんでした。

半導体製造は各国でエッセンシャル事業 (Essential Business) とされてコロナ禍にあっても操業を続けており、当社製品に対する引き合いも以前と比べ変化はありませんでした。ただし、多くの国が入出国に制限を設けたため、従来は本社エンジニアを派遣して実施していた製品立ち上げを海外現地法人のローカルエンジニアが行えるように推進しました。その準備や不慣れな作業から効率が一時的に低下しましたが、結果としてはローカル

エンジニアのスキルアップを果たすことができ、災い転じて今後の業務効率改善の糸口になったのではないかと考えています。

他の事業分野においては、特に中国向けのFPD関連でロックダウンの影響があったこと、国内を主体とする顕微鏡の販売も対面営業ができないことが響いて、これらの分野で計画を下回る結果となりました。

Q4 新中期経営計画フェーズⅢの最終年度とその先の展望を教えてください。

A4 今期(2021年6月期)はフェーズⅢおよび中計全体の総括となる年です。フェーズⅡまでに種をまいたEUV関連などの製品の収穫を確実なものとし、次期中計も見据えた当社の躍進につなげていきたいと考えております。

半導体産業は、周期的な景気の波がありながらも、中長期的には成長を続けていくという見方に変わりはありません。コロナ禍がもたらした新しいライフスタイル

では、5G(第5世代移動通信システム)、AI(人工知能)、IoT(さまざまなものがインターネットにつながる)やADAS(先進運転支援システム)などに対する需要がますます

ます増大すると想定されます。これらの新技術の多くは、高速、低消費電力、大容量などの目的でより高い性能を備えた半導体を必要としますので、最先端の半導体製造分野における設備投資も活発になる見込みです。この成長する半導体産業で、さらに伸びていく新規分野や先端分野に注力することで、市場平均を上回る、より大きな成長の機会を見いだしたいと考えております。

具体的には、特に革新的な半導体製造技術であるEUV分野において、当社が強みとする先進の光学技術や素早い製品開発力などを生かすことで、飛躍的な成長へとつなげるように努めてまいります。世界初のEUV光を用いた2つの検査装置「EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS E120」と「アクティニックEUV

最後に株主さまへメッセージをお願いいたします。

おかげさまで、4期連続で過去最高の業績を更新することができました。今期は、これまでの活動をさらに事業の成長に結び付けて、株主さまのご期待に応える所存です。

レーザーテックは、創業以来「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」を経営理念とし、「世界中のお客さまから何か困ったことがあれば、真っ先に声をかけていただける会社」をビジョンに掲げています。引き続き当社の強みである光学技術に磨きをかけ、グローバルにお客さまのご要望にお応えして企業価値を高めるとともに、最終製品となる身近な電子機器を通じて世界中の人々の豊かな暮らしづくりに貢献してまいります。株主の皆さまにおかれましては、今後とも、

パターンマスク欠陥検査装置ACTIS A150」は、当社の既存製品と比べて数倍の価格帯で販売される高額な製品で、いよいよ今期より売上・利益への貢献が見込まれています。「マスク欠陥検査装置MATRICS X8ULTRA」も引き続き好調な受注と売上を見込んでおり、「EUVマスク裏面検査/クリーニング装置BASICシリーズ」と合わせて、当社の業績を力強く牽引していきます。

一方で将来の成長のための種まきも忘れることはできません。EUV関連のみでなく、ウェハ検査関連やその他新規分野における新製品のご提案にも継続的に取り組んでいます。最終的には、数多くの付加価値の高いオンリーワン製品/ソリューションを提供する『グローバル・マルチ・ニッチトップ企業』を目指してまいります。

一層のご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。



EUVマスク関連装置 のご紹介

EUV (Extreme Ultraviolet) リソグラフィ*とは、極端紫外線といわれる非常に短い波長(13.5nm)の光を用いるリソグラフィ技術で、従来のArF エキシマレーザー光(波長193nm)を用いたリソグラフィに比べ、より微細なパターンを形成できます。

半導体デバイスは、スマートフォンやパソコンなどの身近にある電子機器に使用されています。さらなる小型化・高性能化のため微細化が進んでおり、大手デバイス

EUVリソグラフィ

主要
販売先

ブランクスメーカー

マスクショップ

世界初

2017年
十大新製品賞受賞

ABICS E120

EUVマスクブランク
欠陥検査/レビュー装置



EUV露光装置と同波長(13.5nm)を採用
従来装置では捉えられない、
EUVマスクブランク特有の欠陥を検出

EUVマスクブランク
を検査



世界初

2019年
十大新製品賞受賞

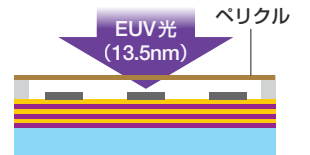
ACTIS A150

アクティニック
EUVパターンマスク
欠陥検査装置



EUV露光装置と同波長(13.5nm)を採用
ペリクル*付きにも対応し、
高感度でEUVパターンマスク特有の欠陥を検出

EUVマスクの
パターン面(表面)を検査



* ペリクル: マスクパターン面への
異物付着を防ぐための保護膜

ペリクル無しEUVマスク
(ペリクル無しEUVマスクも検査可能)

メーカー各社は2019年からEUVリソグラフィによる半導体の量産を開始しました。EUVリソグラフィは、今後普及が進むとされる5G(第5世代移動通信システム)、AI(人工知能)、ADAS(先進運転支援システム)などに不可欠な技術で、最先端の製造工程での採用が拡大しています。

当社では、EUVリソグラフィに対応した高性能な検査装置の需要をいち早く見込み、長年にわたってEUV

マスク欠陥検査に関する基盤技術の確立に努めてきました。現在すでに顧客のご要望にお応えした4製品をラインアップし、積極的な営業活動を推進しています。

※ リソグラフィ: ウェハ上にフォトレジストと呼ばれる光に反応する材料を塗布し、露光装置で光を照射し、薬品に光が当たった部分を除去することで、パターン(例えば線のような形状)を形成する技術。パターンが描かれている複数のフォトマスクが露光装置で使用され、半導体の回路が形成される。

ウェハファブ

MATRICES X8ULTRA

マスク欠陥検査装置



従来の最先端フォトマスクおよび
EUVマスクの両方の検査が可能

EUVマスクの
パターン面(表面)を検査



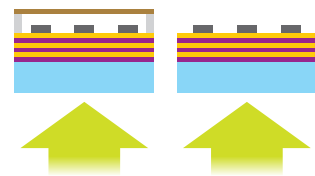
BASICシリーズ

EUVマスク裏面検査/
クリーニング装置



検査に加え、異物の高さ測定および
異物を除去(クリーニング)

EUVマスクの裏面を検査



2020 3/1

シンガポールオフィス営業開始

5つ目となる海外子会社、Lasertec Singapore Service Pte. Ltd.が3月から営業を開始しました。

シンガポールを拠点とし、装置のメンテナンスサービスを提供してまいります。



2020 3/6

インテル社から「2019年度 サプライヤー・アチーブメント・アワード(SAA)」を受賞

この賞はインテル社が重要視する一つの領域で、特に優れた業績を達成したと認定したサプライヤー企業に授与されるもので、当社は初の「SAA」受賞となりました。

2019 SAA

Intel® Supplier Achievement Award



2020 4/15

「The 2020 All-Japan Executive Team Rankings (ベストIR企業ランキング)」に選出

本ランキングは世界の機関投資家・アナリストの投票をもとに、米国大手金融情報誌 Institutional Investor が、優れたIR活動を行う日本の上場企業を選出しています。当社はこのランキングの電機・精密セクターで今回初めて総合3位に選出されました。

2020 5/13

MSCI グローバル・スタンダード・インデックスに採用

5月13日にMSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)社から「MSCI グローバル・インデックス」(株価指数)の定期見直しが発表され、当社株式が「MSCI グローバル・スモール・キャップ・インデックス」(中・小型株を対象)から「MSCI グローバル・スタンダード・インデックス」(大・中型株を対象)の構成銘柄に入れ替えとなりました。

MSCIインデックスの採用基準は、時価総額と流動性によるもので、浮動株比率の高い銘柄が採用されます。世界の機関投資家がベンチマークとしている代表的な株価指数であり、構成銘柄に含まれることで、

グローバル市場においてプレゼンスが高まることが期待されます。

2020 6/25

「半導体・オブ・ザ・イヤー2020」でACTIS A150が半導体製造装置部門グランプリを受賞

電子デバイス産業新聞が主催する「半導体・オブ・ザ・イヤー」は、最新のエレクトロニクス製品の開発において最も貢献した製品を表彰するものです。2019年4月～2020年3月までに発表された製品・技術（バージョンアップ等を含む）を選考対象とし、「開発の斬新性」「量産体制の構築」「社会に与えたインパクト」「将来性」などを基準に、記者の投票により3部門7製品を選出しています。

当社は、2018年の「EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICS E120」、2019年の「マスクブランクス欠陥検査/レビュー装置MAGICSシリーズ M9650/M9651」に続き、半導体製造装置部門初の3年連続のグランプリ受賞となりました。

「アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTIS A150」は、EUV露光装置と同じ波長（EUV光波長13.5nm）を適用した世界初のマスク検査装置です。今回の受賞では「高感度な検査およびEUVパターンマスクに特有の転写性位相欠陥の検出を可能にした」ことや、「次世代半導体製造プロセス（EUV）を構築するために必要な装置」であることなどが評価されました。

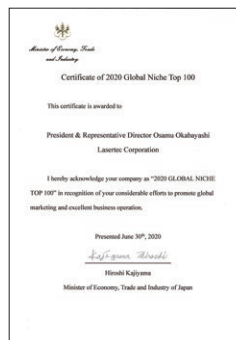
2020 6/30

経済産業省認定 2020年版「グローバルニッチトップ(GNT)企業100選」に選定

経済産業省認定 2020年版「GNT企業100選」は、近年における厳しい経済環境下においても、グローバルのニッチ分野で適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発などで差別化を行い、トップの地位を築いている企業を選定・顕彰したものです。

このたびの審査では、弊社のマスク欠陥検査装置（マスク欠陥検査装置MATRICSシリーズ、アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置ACTIS A150）における優れた技術が半導体産業に大きく貢献し、世界において高い市場占有率を持つことが評価*されました。

※ 評価項目は収益性・戦略性・占有性（世界市場シェア）・国際性（海外売上高比率、販売国数）で、これらを総合的に勘案し、審査



2020年6月期(第58期)の連結決算のご報告

連結貸借対照表(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (2020年6月30日)	前連結会計年度 (2019年6月30日)	科目	当連結会計年度 (2020年6月30日)	前連結会計年度 (2019年6月30日)
資産の部			負債の部		
流動資産	70,002	39,841	流動負債	42,058	18,433
			固定負債	559	514
			負債合計	42,618	18,948
固定資産	11,791	10,214	純資産の部		
			株主資本	39,047	31,019
			① 純資産合計	39,175	31,107
資産合計	81,794	50,055	負債純資産合計	81,794	50,055

連結損益計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	前連結会計年度 (自2018年7月1日 至2019年6月30日)
② 売上高	42,572	28,769
売上原価	19,581	12,853
売上総利益	22,991	15,916
販売費及び一般管理費	7,929	7,975
② 営業利益	15,062	7,941
② 経常利益	15,115	7,834
② 親会社株主に帰属する当期純利益	10,823	5,933

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(百万円未満切り捨て)

科目	当連結会計年度 (自2019年7月1日 至2020年6月30日)	前連結会計年度 (自2018年7月1日 至2019年6月30日)
③ 営業活動による キャッシュ・フロー	16,486	5,800
投資活動による キャッシュ・フロー	△2,038	△994
財務活動による キャッシュ・フロー	△2,800	△1,715
現金及び現金同等物の 期首残高	13,120	10,107
現金及び現金同等物の 期末残高	24,660	13,120

決算のポイント

① 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は391億75百万円となりました。自己資本比率は47.9%、ROE(自己資本当期純利益率)30.8%、ROA(総資産当期純利益率)16.4%となりました。

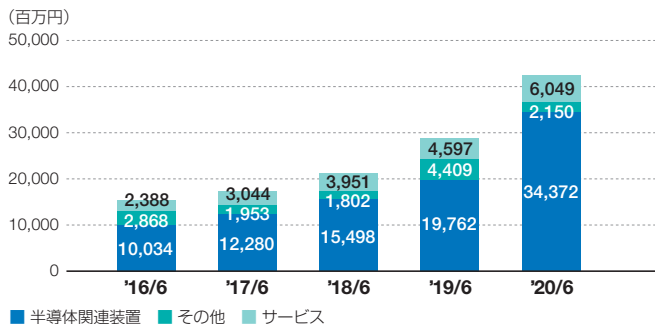
② 売上高/利益

売上高・利益で過去最高額を4年連続で更新しました。EUV関連装置が牽引し売上高は400億円を超え、営業利益は前連結会計年度比90%近く増加しました。

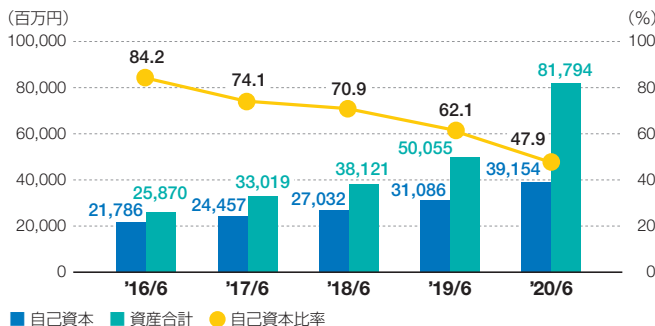
③ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益、前受金の増加などの収入要因が、たな卸資産の増加、法人税等の支払いなどの支出要因を上回りました。

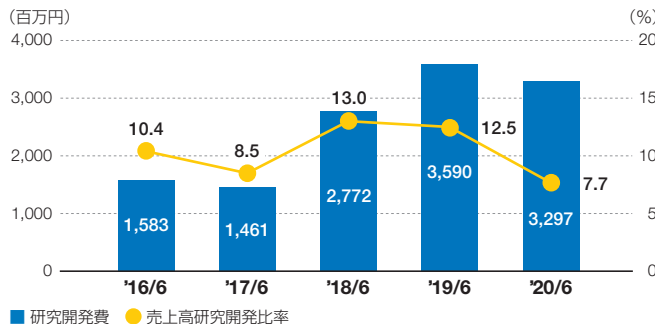
製品別売上高



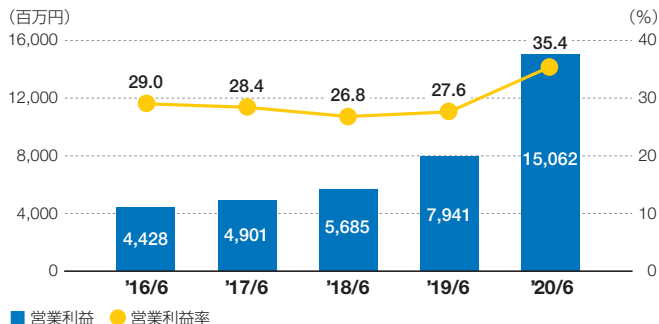
自己資本・資産合計・自己資本比率



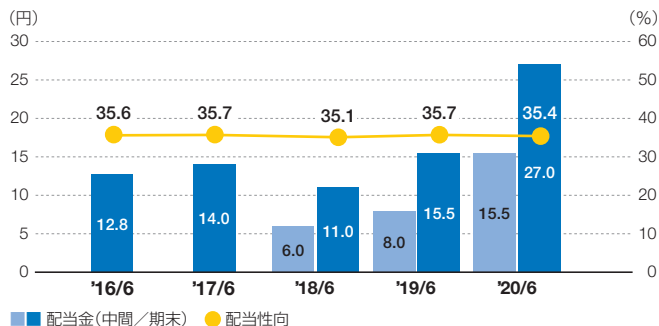
研究開発費・売上高研究開発比率



営業利益・営業利益率

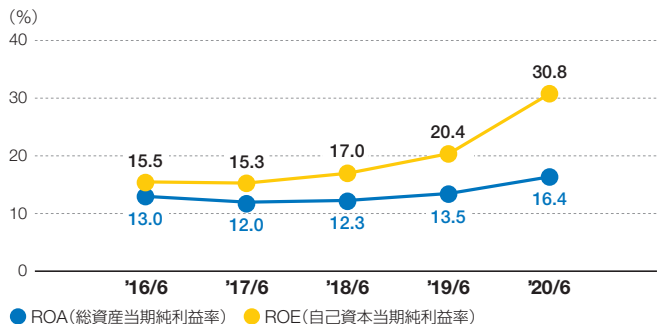


1株当たり配当金・配当性向



※2016年6月期以降、普通株式1株につき2株の割合での株式分割を2回実施いたしました(2017年4月1日付および2020年1月1日付)。経年比較のため、上記の金額は2016年6月期の期首にこれらの株式分割が行われた仮定で算定しております。
また、2018年6月期より中間配当を実施しております。

ROA・ROE



※2018年6月期の会計方針の変更に伴い、2017年6月期の決算数字を遡り適用し変更しています。

会社概要 (2020年6月30日現在)

社名	レーザーテック株式会社
所在地	〒222-8552 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1
設立	1962年8月
資本金	9億3,100万円
主な事業内容	下記製品の開発・製造・販売・サービス 1. 半導体関連装置 2. エネルギー・環境関連製品 3. レーザー顕微鏡関連製品 4. FPD関連装置
従業員数	連結 448名 単体 288名
お問い合わせ先	045-478-7127 (経営企画室)

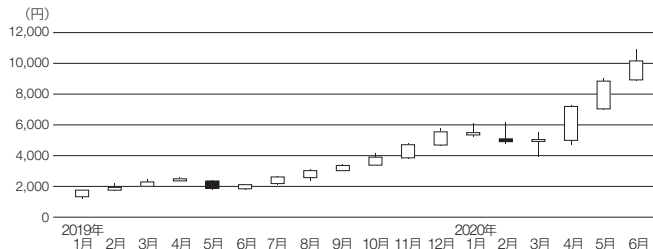
株式情報 (2020年6月30日現在)

株式概要

上場市場	東京証券取引所市場第一部
発行済株式総数	94,286,400株
株主数	24,419名
大株主一覧	持株数(千株) 持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,895 6.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4,389 4.86
内山 靖子	4,006 4.44
内山 洋	3,483 3.86
株式会社三菱UFJ銀行	3,008 3.33
内山 秀	2,788 3.09
前田 せつ子	2,587 2.86
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS	2,461 2.72
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1,809 2.00
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	1,509 1.67

- (注)1. 当社は、自己株式を4,108千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株価の推移



役員 (2020年9月28日現在)

代表取締役社長 岡林 理	社外取締役 海老原 稔 下山 隆之 三原 康司
代表取締役副社長 楠瀬 治彦	常勤監査役 塚崎 健明 浅見 公一
常務取締役 内山 秀 森泉 幸一	監査役 石黒 美幸 出雲 栄一
取締役 関 寛和	

株主メモ

事業年度 7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会 毎年9月
基準日 毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)

単元株式数 100株
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座管理機関
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711(通話料無料)
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>
ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。

(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店においても取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の本店でお支払いいたします。

当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp/ir/>

Webサイト「株主・投資家の皆さま」にも詳細なIR情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

企業ホームページ
最優秀サイト
2019
日経AI・オール
総合ランキング

IR情報公開コンプライアンス
調査
2019年

